Магнитооптические и магнитные свойства ионно-имплантированных пленок (YBiSmTm) $_3$ (FeGa) $_5$ O $_{12}$

© Г.Г. Васильев, В.Н. Заблуда, В.Е Осуховский*, И.С. Эдельман

Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук, 660036 Красноярск, Россия
*Дальневосточный государственный университет,

*Дальневосточный государственный университет 690000 Владивосток. Россия

(Поступила в Редакцию 12 июля 1996 г. В окончательной редакции 3 марта 1997 г.)

На пленках $(YBiSmTm)_3(FeGa)_5O_{12}$, имплантированных ионами He^+ , обнаружены сильные зависимости меридионального эффекта Керра от режима имплантации, различные в разных участках спектра. Наряду с эффектом Керра исследованы зависимости намагниченности, магнитной анизотропии, температуры Нееля от условий имплантации. Отмечены корреляции в поведении магнитных, магнитооптических и электрических свойств имплантированных слоев.

Ранее в [1,2] нами было исследовано влияние имплантации ионами Ne⁺ на физические свойства (магнитные, электрические, магнитооптические) пленок $Y_3F_5O_{12}$ и (YLuSmCa)₃(FeGe)₅O₁₂ и было выявлено существенное изменение спектров меридионального эффекта Керра, зависящее от энергии и дозы имплантации, которое объяснялось предположительно перераспределением вкладов от различных электронных переходов в наблюдаемый эффект. Однако наблюдаемая в [1,2] картина осложнялась небольшой глубиной имплантированного слоя, характерной для ионов неона [3], по сравнению с суммарной глубиной пленки. Глубина проникновения ионов Не+ приблизительно втрое больше при одинаковых значениях энергии, а полуширина кривой распределения дефектов по глубине образца существенно больше по сравнению с неоном [3]. Поэтому в настоящей работе проведено исследование меридионального эффекта Керра α и магнитного кругового дихроизма (МКД), а также намагниченности M, температуры Нееля T_N , магнитной анизотропии и керровских петель гистерезиса пленок (YBiSmTm)₃(FeGa)₅O₁₂ с цилиндрическими магнитными доменами (ЦМД) толщиной $1.1\,\mu\mathrm{m}$ на подложке галий-гадолиниевого граната с ориентацией (111), имплантированных ${
m He^+}$ дозами (D) от $2\cdot 10^{14}$ до $10^{16}\,{
m cm^{-2}}$ при энергиях $E_1 = 100 \,\mathrm{keV}$ и $E_2 = 300 \,\mathrm{keV}$. Толщина ионно-имплантированного (ИИ) поверхностного слоя составляла 0.5 и $1.1\,\mu{\rm m}$ соответственно. Таким образом, в одной серии образцов для $E = E_1$ только часть образца по глубине была затронута имплантацией аналогично исследованным ранее пленкам гранатов [1,2], в то время как во второй серии $E=E_2$ пленки были проимплантированы на всю глубину. При измерении α поле в плоскости образца составляло 2 kOe, угол падения р-поляризованной световой волны на плоскость образца был равен 63°, погрешность измерения α -0.1. МКД измерялся в магнитном поле, равном 5.0 kOe, нормальном плоскости образца и параллельном направлению распространения света. Погрешность измерения составляла $10^{-5} \, \text{cm}^{-1}$. Намагниченность M, T_N и поле

анизотропии, как перпендикулярной H_u , так и плоскостной H_i , измерялись магнитостатическими методами при последовательном стравливании ИИ-слоя.

На рис. 1, a, b показаны дозовые серии α в коротковолновой области спектра для E_1 и E_2 . Следует отметить, что два интенсивных максимума ($\lambda_1 = 483\,\mathrm{nm}$ и $\lambda_2 = 445 \, \mathrm{nm}$) в спектре α неимплантированной пленки расположены практически там же, где и соответствующие максимумы в спектре α пленки железо-иттриевого граната (ЖИГ) [1], но в более коротковолновой области наблюдается сильное различие спектров α . Для ЖИГ α меняет знак и проходит через отрицательный максимум вблизи 400 nm, а для исследованной в настоящей работе пленки ЦМД в области $\lambda < \sim 400\,\mathrm{nm}$ имеется широкая бесструктурная область с приблизительно постоянным значением α . Поведение $\alpha(D)$ в Ві-гранате, как и в пленках ЖИГ, характеризуется сильной зависимостью от дозы и энергии имплантации во всем спектральном диапазоне. Особенно сложное поведение имеет место в области $\lambda > 470 \, \text{nm}$; оно, по-видимому, обусловлено интерференцией, вызванной отражением света от границы пленка-полдожка, и в настоящей работе нами не обсуждается.

Как известно, одним из основных результатов имплантации ЦМД-пленок является формирование в имплантированном слое анизотропии типа "легкая плоскость", в то время как в неповрежденных имплантацией частях пленки сохраняется перпендикулярная анизотропия. Ранее [1,4] было отмечено, что сильная дисперсия оптического поглощения в ферритах-гранатах позволяет, выбирая область спектра, извлекать из полевых зависимостей α информацию о магнитных свойствах поверхностного слоя образца определенной толщины. В частности, при меридиональном эффекте Керра будет наблюдаться прямоугольная петля гистерезиса, если плотность дефектов обеспечивает анизотропию типа "легкая плоскость" на некоторой глубине образца и свет используемой длины волны проникает только на эту глубину. Если свет проникает также на глубину образца, не затронутую

8* 1267

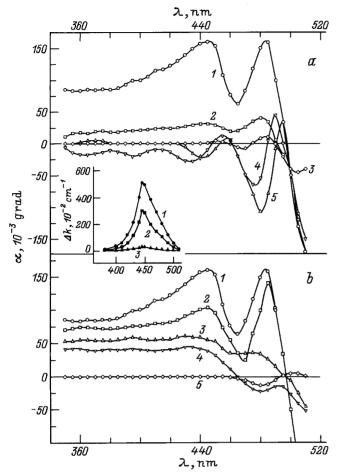


Рис. 1. Дисперсия α в пленках (YBiSmTm) $_3$ (FeGa) $_5$ О $_{12}$, имплантированных ионами He $^+$. a) $E_1=100\,\mathrm{keV}$. Дозы D (He $^+$ /cm 2): I=0, $2=5\cdot10^{14}$, $3=10^{15}$, $4=2\cdot10^{15}$, $5=5\cdot10^{15}$. b) $E_2=300\,\mathrm{keV}$. Дозы D (He $^+$ /cm 2): I=0, $2=2\cdot10^{14}$, $3=5\cdot10^{14}$, $4=5\cdot10^{15}$, $5=10^{16}$. На вставке — дисперсия МКД $\Delta k=k_+-k_-$, где k_+ и k_- — коэффициенты поглощения право- и левополяризованных волн для некоторых образцов, представленных на рис. 1,b.

имплантацией, то форма петли гистерезиса отклоняется от прямоугольной. Таким образом, критерием выявления спектрального диапазона, в котором свет проникает на глубину имплантированного слоя, может быть выбран коэффициент прямоугольности петель гистерезиса α $Q = \alpha_r/\alpha_s$, где α_r — величина α в нулевом магнитном поле, а α_s — в поле насыщения. В предельных случаях идеально перпендикулярной и идеально плоскостной анизотропии Q равно нулю и единице соответственно. Для энергии имплантации E_2 во всей исследованной спектральной области, начиная с $D = 5 \cdot 10^{14} \,\mathrm{He^{+}/cm^{2}}$, петля гистерезиса α приобретает прямоугольную форму, тем самым показывая, что вектор намагниченности в имплантированном слое пленки лежит в плоскости образца, а поведение спектров α характеризует только изменение свойств имплантированного слоя. Другая картина имеет место для серии с меньшей энергией имплантации E_1 : при такой же дозе облучения Q=1 наблюдается только при $\lambda<380$ nm, хотя из кривой зависимости $\Delta H(D)$, снятой на образцах из этой серии (кривая 5 на рис. 2), следует, что величина возникающей при имплантации плоскостной магнитной анизотропии начинает превышать величину одноосной перпендикулярной анизотропии при $D\approx(3-5)\cdot10^{14}\,\mathrm{He^+/cm^2}$; таким образом, при $\lambda>380\,\mathrm{nm}$ глубина проникновения света превышает толщину имплантированного слоя.

Рассмотрим более ясный случай, отраженный на рис. 1, b, когда практически весь объем пленки проимплантирован. На рис. 2 показаны зависимости α для $\lambda_1 = 350 \, \text{nm}$ (кривая 1) и $\lambda_2 = 445 \, \text{nm}$ (кривая 2), а также намагниченности M температуры T_N от дозы имплантации в этих образцах. На вставке к рис. 1 приведены спектры МКД этих же образцов. Поведение пика, наблюдаемого в спектре МКД, повторяет поведение $\alpha(D)$ в этих образцах вблизи λ_2 с изломом в области $D = 5 \cdot 10^{14} \, \text{He}^+/\text{cm}^2$. Если сравнить зависимость $\alpha(D)$ при λ_2 с зависимостями $\alpha(D)$ при других значениях λ , где α линейно по $\lg D$, то наблюдаемую в области λ_2 картину можно представить как наложение некоторого пика и бесструктурной полосы. При $D \approx 5 \cdot 10^{14} \, \mathrm{He^{+}/cm^{2}}$ пик полностью исчезает, а бесструктурная полоса ведет себя при изменении D так же, как и в остальной части спектра. Таким образом, излом в зависимости $\alpha(D)$ для $\lambda = 445\,\mathrm{nm}$ связан с изсчезновением пика вследствие нарастания дефектности пленки. Экстраполяция обеих кривых $\alpha(D)$ (кривые 1 и 2 на рис. 2) к соответствующим значениям α в неимплантированном образце показывает, что начиная с $D \approx 8 \cdot 10^{13} \, \mathrm{He^{+}/cm^{2}}$ идет последовательное подавление магнитных и магнитооптических свойств в ИИ-слое. Однако зависимости α и МКД от D не

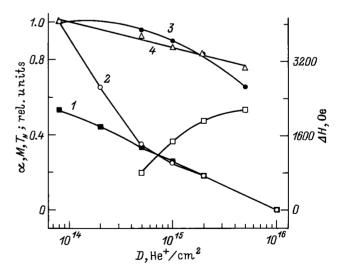


Рис. 2. Дозовые зависимости эффекта Керра для 350 (1) и 445 nm (2), намагниченности (3), температуры Нееля (4), разности полей плоскостной и перпендикулярной магнитной анизотропии $\Delta H = H_i - H_u$ (5) для пленок (YBiSmTm)₃(FeGa)₅O₁₂, имплантированных He⁺ при энергиях 300 (1–4) и 100 keV (5).

могут быть объяснены только поведением M(D). Одной из причин более быстрого уменьшения α и МКД при имплантации по сравнению с уменьшением М может быть изменение вероятностей обусловливающих их электронных переходов, причем характер этих изменений различен для разных типов переходов. В [5,6] нами было показано, что в области $\lambda = 445\,\mathrm{nm}$ в спектре α ЖИГ нахолится перехол с переносом заряда между тетраэдрическими (Fe⁺³) и октаэдрическими [Fe⁺³] ионами железа, более чувствительный к разрушению магнитного порядка при повышении температуры по сравнению с внутриконфигурационными d-d-переходами, которые также имеют место в этой сректральной области. При имплантировании ионами Ne^+ пленок ЖИГ этот пик в спектре α уменьшался гораздо быстрее по сравнению с остальными и исчезал при $D = 2 \cdot 10^{14} \,\mathrm{Ne^{+}/cm^{2}}$ [1] аналогично пику при $\lambda = 445\,\mathrm{nm}$ в исследованных в настоящей работе ЦМД-пленках, который исчезает при $D = 5 \cdot 10^{14} \, \text{He}^{+}/\text{cm}^{2}$. Различие доз объясняется большей дефектообразующей способностью неона, облусловленной его большим ионным радиусом. Все это позволяет нам интерпретировать этот пик как переход с переносом заряда $(Fe^{+3}) \to [Fe^{+3}].$

На рис. 2 приведена вышеупомянутая зависимость $\Delta H = H_i - H_u$ от дозы имплантации для энергии $E_1 = 100 \,\text{keV}$ (кривая 5). При $D = 3 \cdot 10^{14} \,\text{He}^+/\text{cm}^2$ магнитная одноосная перпендикулярная анизотропия K_{μ} становится меньше анизотропии типа "легкая плоскость" Кі, возникающей при имплантации. В этом случае анизотропия "легкая плоскость" возникает при несколько меньшей дозе, чем в случае энергии имплантации E_2 , что может быть вызвано более высокой плотностью дефектов в имплантированном слое меньшей глубины. Более высокой плотностью дефектов при E_1 , по-видимому, объясняется и различное поведение α в дозовых сериях на рис. 1, a и b, где более существенные изменения спектров α (вплоть до изменения знака эффекта) отмечаются именно в серии E_1 , а осцилляции α на кривой 5, возможно, связаны с интерференцией отраженного света от появившейся резкой границы имплантированныйнеимплантированный слои в исследуемой пленке.

В [1] нами было отмечено, что на зависимости электропроводности от дозы имплантации $\sigma(D)$ для пленок ЖИГ наблюдаются два излома: первый при $D = 2 \cdot 10^{14} \, \text{Ne}^{+}/\text{cm}^{2}$, после которого проводимость возрастает быстрее с увеличением D, и второй при $D = 5 \cdot 10^{14} \, \text{Ne}^+/\text{cm}^2$, после которого рост проводимости замедляется. Обоим этим изломам $\sigma(D)$ соответствуют изломы в дозовых зависимостях α ЖИГ. первой дозе исчезает максимум, связанный с переходом $(Fe^{3+}) \rightarrow [Fe^{3+}]$, а при второй изменяется знак. Для случая имплантации Не+ данные о зависимости $\sigma(D)$ имеются также только для пленок ЖИГ [2]. Первый излом $\sigma(D)$ наблюдался в этом случае при $D = 5 \cdot 10^{14} \,\mathrm{He^+/cm^2}$. Именно при этой дозе имплантации He^+ наблдается излом на зависимости $\alpha(D)$ для максимума при $\lambda = 445\,\mathrm{nm}$ в исследованных в настоящей работе образцах, который мы связываем с переходом $(Fe^{3+}) o [Fe^{3+}].$

Возрастание проводимости при имплантации связывается в [1] с появлением дополнительных примесных центров в запрещенной зоне. Основу этих центров формируют ионные вакансии, для сохранения электронейтральности ближайшие к вакансии ионы Fe^{3+} понижают свою валентность до Fe^{2+} . Первый излом на дозовой зависимости проводимости соответствует переходу к переносу заряда по примесной зоне, а это в свою очередь связано с существенным возрастанием концентрации Fe^{2+} . По-видимому, возрастание концентрации ионов Fe^{2+} , которые преимущественно занимают октаэдрические [7] позиции, приводит к более резкому уменьшению интенсивности переходов $(Fe^{3+}) \rightarrow [Fe^{3+}]$ и излому на дозовой зависимости α для $\lambda = 445$ nm.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант 95-02-03669).

Список литературы

- I.S. Edelman, G.G. Vasiljev, V.N. Berzhansky, V.E. Petrov. J. Magn. Magn. Mater. 111, 171 (1992).
- [2] В.Н. Бержанский, В.Е. Петров, И.С. Эдельман, Г.Г. Васильев. Препринт ИФ СО АН СССР № 686Ф. Красноярск (1991).
- [3] Д. Мейер, Д. Эриксон, Д. Девис. Ионное легирование полупроводников. Мир, М. (1973). 331 с.
- [4] J. Martens, W. Godlieb. J. Appl. Phys. 58, 3180 (1985).
- [5] Г.Г. Васильев, И.С. Эдельман, В.Е. Петров, В.Н. Заблуда, В.Н. Бержанский. Препринт ИФ СО АН СССР № 513Ф. Красноярск (1988).
- [6] Г.Г. Васильев, И.С. Эдельман, В.Е. Петров, В.Н. Бержанский. ФТТ **32**, *1*, 269 (1990).
- [7] Ю.Д. Третьяков. Термодинамика ферритов. Химия, Л. (1967). 27 с.